

2026年度 大阪大学 ARIM 技術セミナー

初心者からプロまで！ 電子ビーム描画装置の活用法 ～ver.5～

大阪大学マテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点（ARIM）は、令和3年度からスタートした文部科学省委託事業である「マテリアル先端リサーチインフラ事業」の一環として、装置メーカーによる技術セミナー『微細加工・電子ビーム露光技術』を**2026年7月6日(月)13:00～2026年7月10日(金)**に開催いたします。

初日は最先端の自動搬送型超高精細電子ビーム描画装置の構成や実際に用いた微細加工の原理と考え方や露光条件の検討手法についてご紹介、後半は実機を用いてメーカー技術者とman-to-manの質疑応答が可能です。産学官いずれのご所属の方にも奮ってのご参加をお待ちしております。

◇講演

【日時】 2026年7月6日(月)～7月10日(金)

【参加費】 全日無料

【月曜日のみオンライン】 定員100名(先着順, 参加登録をお願いします)

【火曜日～金曜日】 定員7組（1組当たりの人数制限はありません）

【お申込み】

7/6 申込み : <https://forms.cloud.microsoft/r/ngfdXY61Cc?origin=lprLink>

7/7～7/10 申込み : <https://forms.cloud.microsoft/r/3eyMd1EsQK?origin=lprLink>

【お申込み締め切り】 2026年6月19日(金)



7/6 申込み



7/7～7/10 申込み

◇講演プログラム（オンライン）

13:00-13:05 はじめに

大阪大学 産業科学研究所 田中 裕行

13:05-15:00 『描画装置の基礎講座』

株式会社エリオニクス 国内営業本部 杉原 達記

◇火曜日～金曜日は実機を用いてメーカー技術者とman-to-manの装置活用個別相談会

9:30-12:30 午前の部・14:00-17:00 午後の部

株式会社エリオニクス 国内営業本部 杉原 達記

金曜日のみ午前の部で終了いたします。ご了承ください。

*ご参加者様より電子ビーム描画プロセスなど微細加工に関するご質問、課題について自由に御相談頂けます。

【主催】 大阪大学マテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点（ARIM）

【共催】 株式会社エリオニクス

お問い合わせ

大阪大学マテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点（ARIM）事務局

E-mail : info-nanoplat@sanken.osaka-u.ac.jp

